





摘要



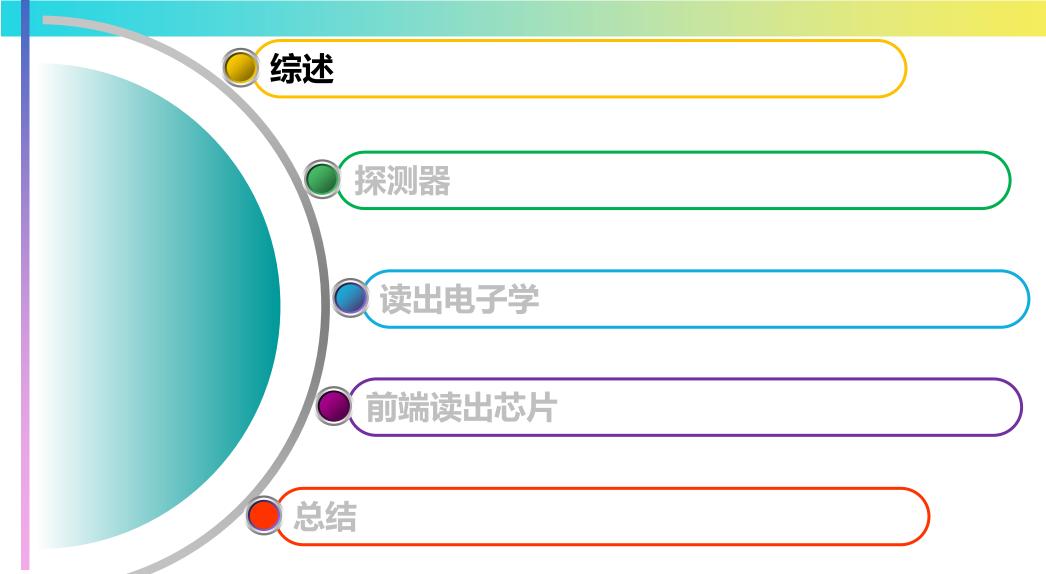




摘要



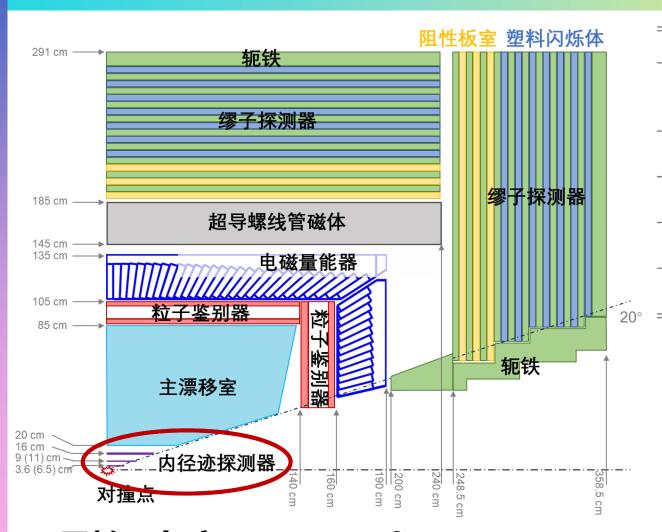




谱仪系统组成







Physics Process	Optimized Sub-detector	Requirements	
$ au o K_s \pi \nu_{ au},$		acceptance: 93% of 4π ; trk. effi.:	
$J/\psi o \Lambda \bar{\Lambda},$	Tracker	$> 99\%$ at $p_T > 0.3$ GeV/c; $> 90\%$ at $p_T = 0.1$ GeV/c	
$D_{(s)}$ tag		$\sigma_p/p = 0.5\%$, $\sigma_{\gamma\phi} = 130 \mu\mathrm{m}$ at 1 GeV/c	
$e^+e^- \rightarrow KK + X$,	PID	K/π separation ($p < 2 \text{ GeV/c}$):	
$D_{(s)}$ decays	PID	3σ , efficiency > 99%	
$ au ightarrow \mu \mu \mu$,	MUC DID	π/μ suppression power over 30 at $p < 2$ GeV,	
$D_s o \mu \nu$	MUC, PID	μ efficiency over 95% at $p = 1$ GeV	
$\tau \rightarrow \gamma \mu$,	EMC	$\sigma_E/E \approx 2.5\%$ at 1 GeV	
$\psi(3686) \to \gamma \eta(2S)$	EMC	$\sigma_{\rm pos}$ = 4 mm at 1 GeV	
$e^+e^- \rightarrow n\bar{n},$	EMC MUC	$\sigma_{x} = \frac{300}{100}$ ps	
$D_0 \to K_L \pi^+ \pi^-$	EMC, MUC	$\sigma_T = \frac{300}{\sqrt{p^3(\text{GeV}^3)}} \text{ ps}$	

◆ 内径迹探测器 (ITK, 两种技术路线)

► MPGD: cylindrical MPGD

► Silicon: CMOS MAPS

灵敏区角度: 94%•4π (θ~20°)

气体型内径迹探测器

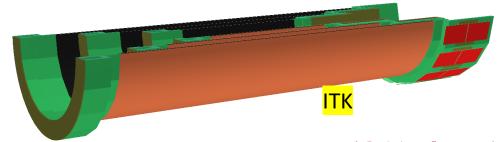




为了在高亮度实验中实现径迹测量,内径迹探测器需要满足如下要求:

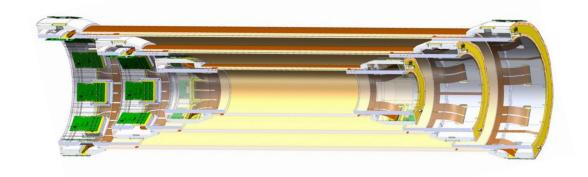
- ▶ 在1T磁场下实现良好的位置分辨 (< 100 μm)
- ▶ 极低的物质量 (< 0.3% X₀)</p>
- > 具备高计数率能力

>



可能的选项之一:

圆柱型MPGDs



- ・易于弯曲为圆柱形
- ・低物质量
- ・较低成本

低物质量圆柱形MPGD





BESIII c-GEM

▶ 最大尺寸: D=323.8mm, L=847mm

▶ 物质量: ~ 0.5%X₀

基于电荷重心法的位置分辨(<5°): ~ 200 μm</p>

➢ 对于MIP的探测效率: ~ 95%

INFN-LNF c-μ**RWELL** prototype

➤ 尺寸: D=168.5mm, L=600mm

▶ 物质量: ~ 0.6%X₀

基于电荷重心法的位置分辨(<3°): ~ 460 μm</p>

➢ 对于MIP的探测效率: > 95%

CLAS12 c-Micromegas

▶ 尺寸: D=207.5mm, L=712mm

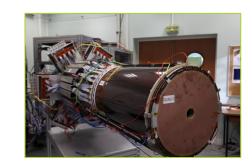
> 物质量: 未有公开资料

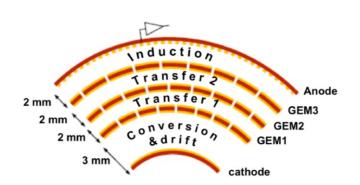
位置分辨: ~ 432μm (5T)

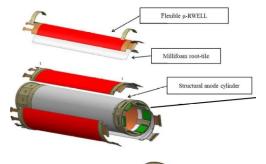
> 探测效率: ~ 90%

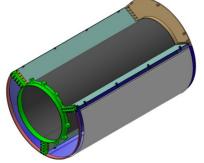








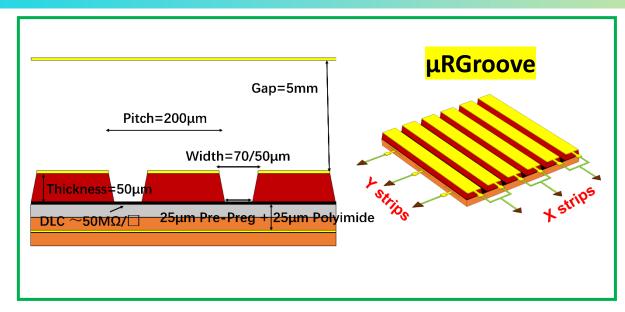




微槽型MPGD (μRGroove)









- μRGroove的阴极本身可用于其中一个维度的信号读出
- ✓ X与Y读出条解耦,避免感应电荷共享效应, 从而有效提升信号幅度

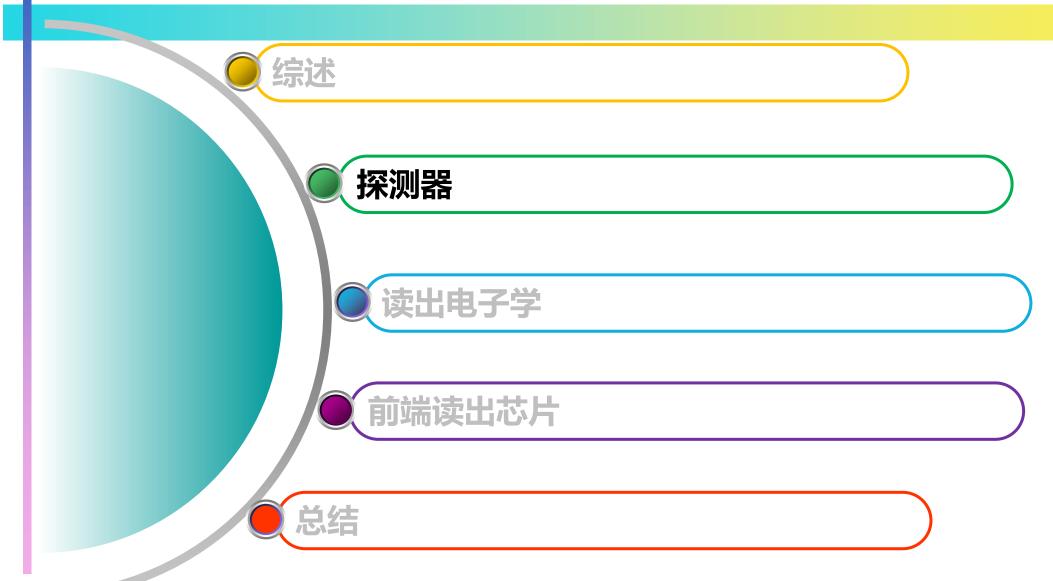
口 圆柱形μRGroove:

- ✓ 结构简洁: 仅包含漂移区与µRGroove电极
- ✓ 每个电极都包含支撑结构
- ✓ 更低的物质量: 仅需额外增加1个维度的 读出条
- ✓ 易于清洗,以便长期维护

摘要



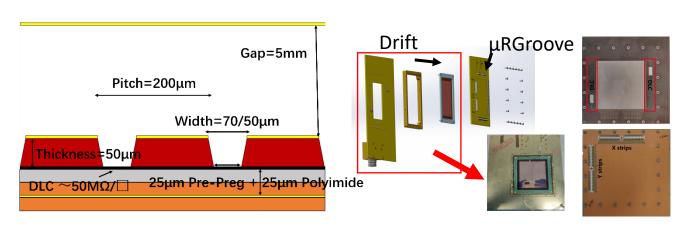


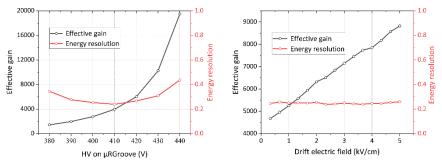


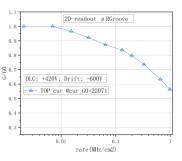
工作基础——平面型µRGroove





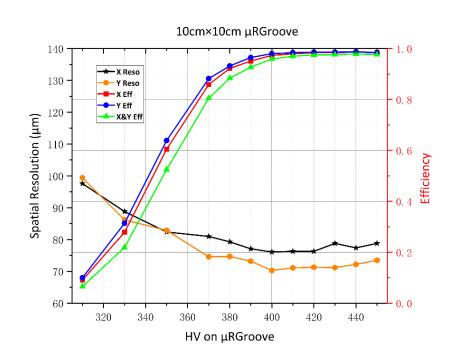








- ✓ 信号有效增益> 10⁴、能量分辨~25%
- ✓ 探测效率~97.9%、位置分辨< 80 µm

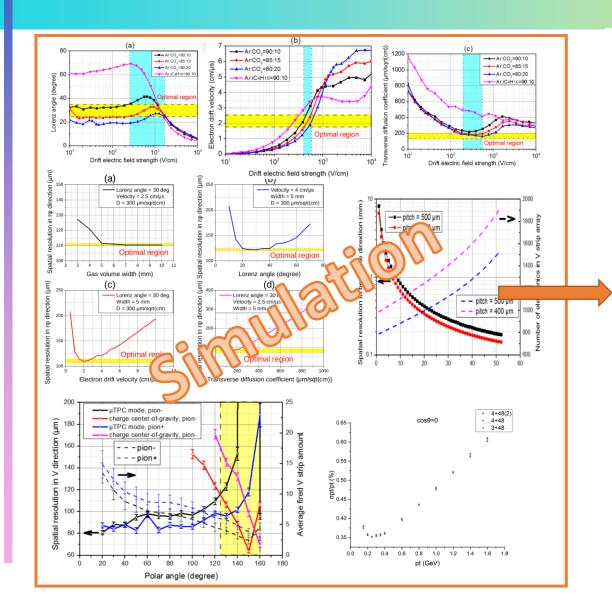


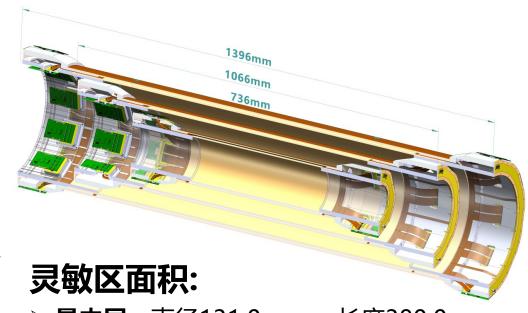
- ✓ 与µRWELL的制作工艺兼容
- ✓ 易于生产、成本低

STCF-ITKW概念设计









▶ 最内层: 直径131.0 mm、长度380.0 mm

▶ **中间层:** 直径229.4 mm、长度650.0mm

▶ **最外层:** 直径327.9 mm、长度920.0mm

· **读出方式**: UV二维读出、400 μm条中心距

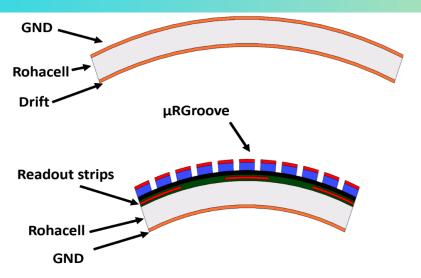
• 气隙: 基于本底与µTPC重建精度设置为5 mm

• 工作气体参数: 扩散、漂移速度与洛伦兹角等

原型C-μRGroove的层叠结构







口 首个C-μRGroove原型样机:

- ・ 灵敏区尺寸: 直径131.0 mm、长度100.0 mm
- ・ 外筒为漂移极、内筒为μRGroove PCB
- 可拆卸式机械设计
- · 倍增结构开口向外
- · 内外筒均包含支撑结构
- · 内外同均也召文撑结构

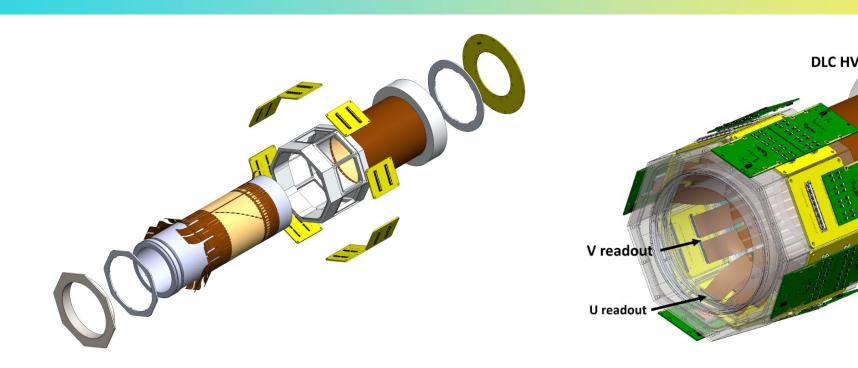
Structure	Material	Thickness (cm)	Material budget (X0
Structure	LMB-GND		2*0.001138%
	Polyimide (X0=28.57cm)	0.0025*2	0.0175%
Drift electrode	Glue (X≈20cm)	0.001*2	0.01%
	Rohacell (X0≈689cm)	0.2	0.029%
Gas volume	Argon-based gas mixture (X0=11760cm)	0.5	0.00425%
Inner cylinder (μRGroove foil)	Cu (X0=1.43cm)	0.0015*65%	0.0682%
	Cr (X0=2.077cm)	0.000001*65%	0.0000313%
	Apical (X0=28.57cm)	0.005*70%	0.01225%
	Glue (X0≈20cm)	0.001*5	0.025%
	Kapton (X0=28.57cm)	0.0025*2	0.0175%
	AI (X0=8.892cm)	0.0012*(1*33.6%)	0.00453%
	DLC (X0=12.13cm)	0.0001	0.00082%
	Polyimide (X0=28.57cm)	0.0025	0.00875%
	Rohacell (X0≈689cm)	0.2	0.029%
	LMB-GND		0.001138%
Total			0.2302%

机械结构设计



Drift HV







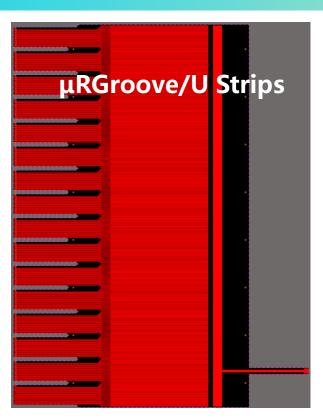
- 机械式密封确保探测器可拆卸
- 隔片用于提供均匀的5 mm漂移间隙

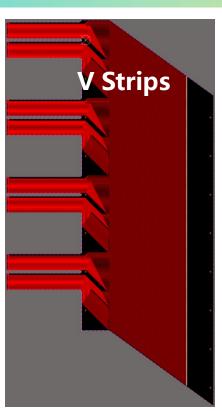
- ・ 三个主要组成部分: 读出电子学端 (FEE) 、 灵敏区、高压端 (HV)
- · 电极基于柔性基板设计,可以弯曲以连接至 连接器

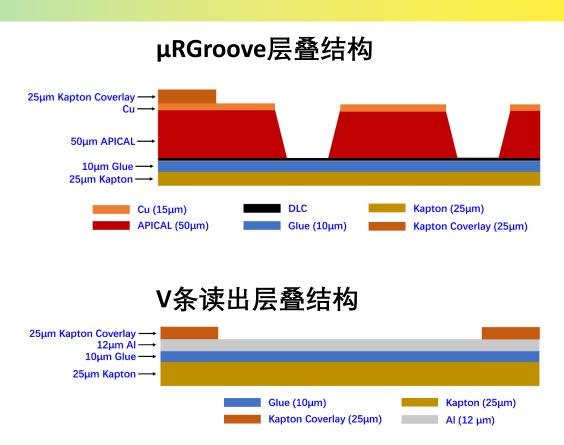
μRGroove读出条设计











- ・ U/V二维读出,条中心距:U条为0.4 mm,V条为0.8 mm,UV条夹角为15°...
- · 2个PCB分别负责其中一维读出
- · 25 μm厚的Kapton材质基板
- · 铝制V型读出条

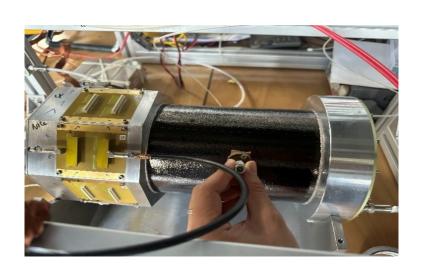
增益与能量分辨率测试

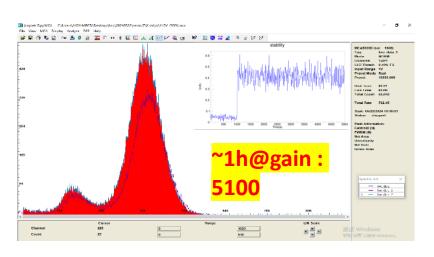


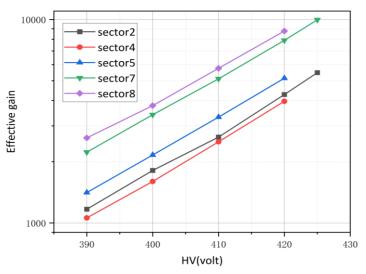


测试条件:

- 气体: Ar:iC₄H₁₀/95:5
- 放射源: 55Fe
- ・ 从U条 (阴极) 读出
- · V条接地
- 使用Ortec142AH/671 + MCA分析
- · 通过信号幅度谱实现增益测量







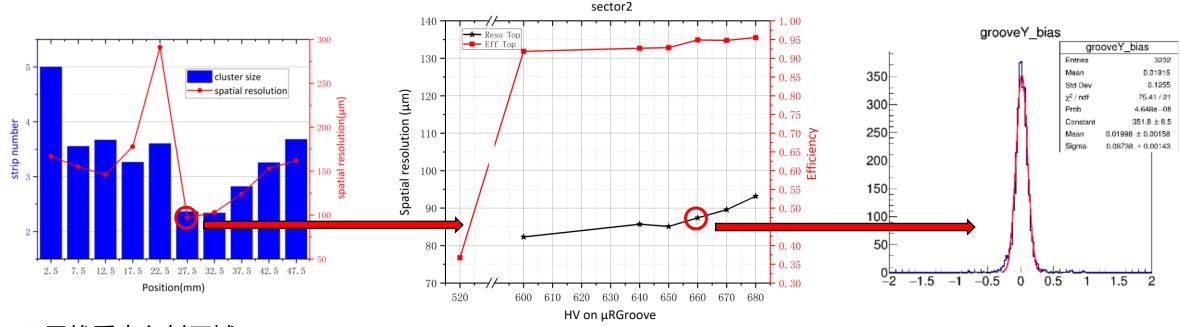
- ✓ 能量分辨率: ~26%
- ✓ 有效增益: 4000 ~ 10000
- ✓ U条与V条信号大小相似
- ✓ 在低湿度下稳定性良好
- × 由于气体 (流动) 导致增益均匀性较差

探测效率与位置分辨





・ 使用电荷重心法 (CC) 对垂直入射粒子进行分析



- ✓ 寻找垂直入射区域
- ✓ 使用电荷重心法进行分析
- × 褶皱可能会导致位置分辨降低

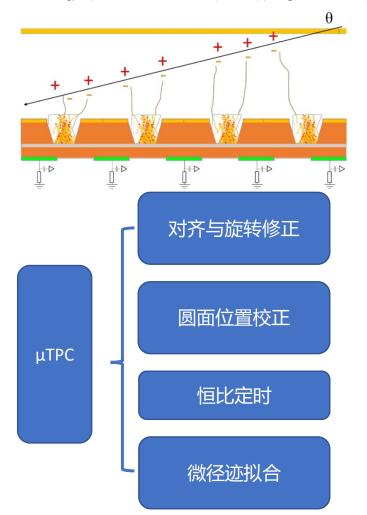
- ✓ 垂直入射粒子的位置分辨: 83~93 µm
- ✓ 探测效率>95%

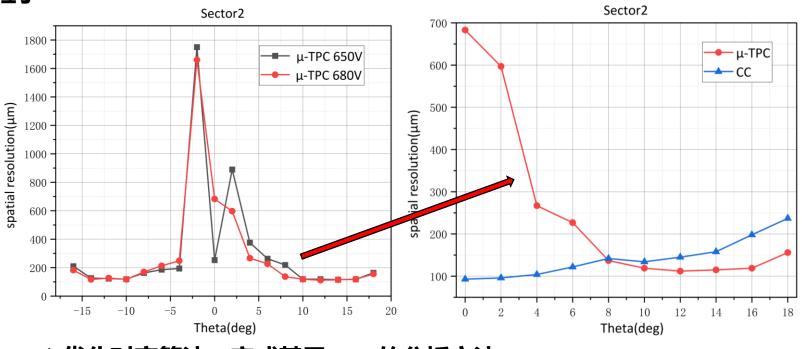
探测效率与位置分辨





・ 使用Micro TPC方法分析斜入射粒子





- ✓ 优化对齐算法,完成基于µTPC的分析方法
- ✓ 当入射角大于8°时,使用μTPC可获得更好的位置分辨 (<120 μm, 含径迹误差)
- ✓ 完善径迹误差评估方法, 待测维度径迹误差约为43µm

磁场中的束流测试

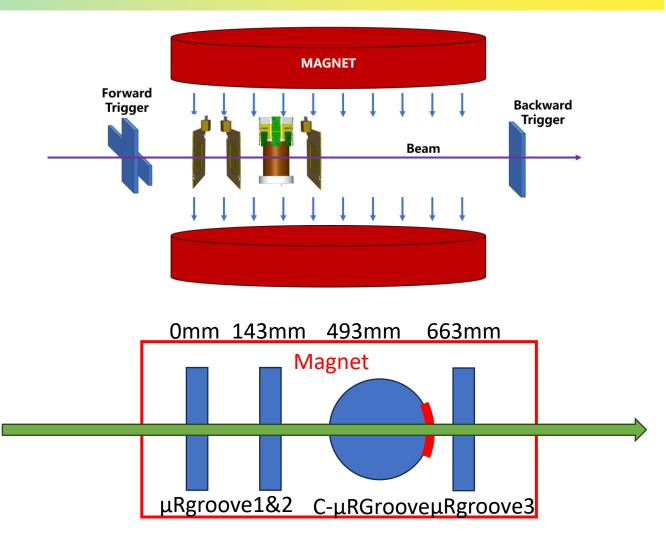




测试条件:

- 工作气体: Ar:CF₄:CO₂/45:40:15
- ・ 从U条 (阴极) 读出、V条接地
- 使用APV25+SRS+mmDAQ分析
- ・ 前后触发探测器之间的距离约为8米
- · 3个平面型µRGroove用于重建径迹
- 0.5 ~ 1.0 Tesla磁场

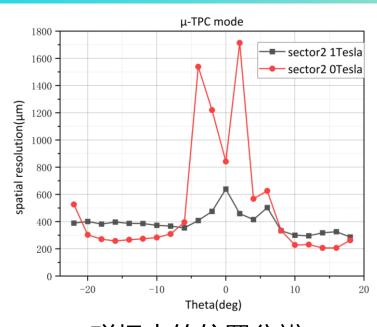




磁场中的束流测试



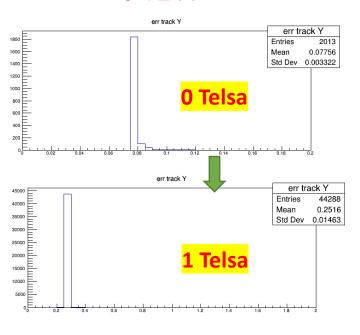




磁场中的位置分辨

Tracker 性能

径迹误差



0 Tesla: 最佳位置分辨率~200微米。

较前次实验偏高,主要由于气体变化引起的漂移速度加快

1 Tesla: 最佳位置分辨率~300 μm 及~1.2 mm 偏移

Tracker (平面型μRGroove) 受磁场影响很大。径迹误差从77μm (无磁) 剧烈劣化为251μm (1T)

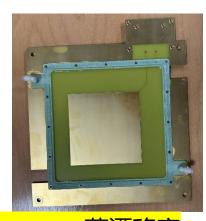
Tracker 定位有偏,使得重建径迹有偏

准备7月磁场下束流测试

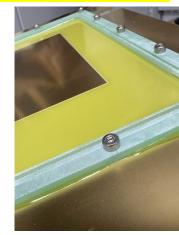




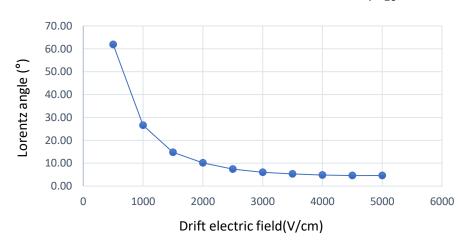




Trackers 薄漂移窗



Simulation results of Lorentz angle of Ar:iC₄H₁₀ (98/2)



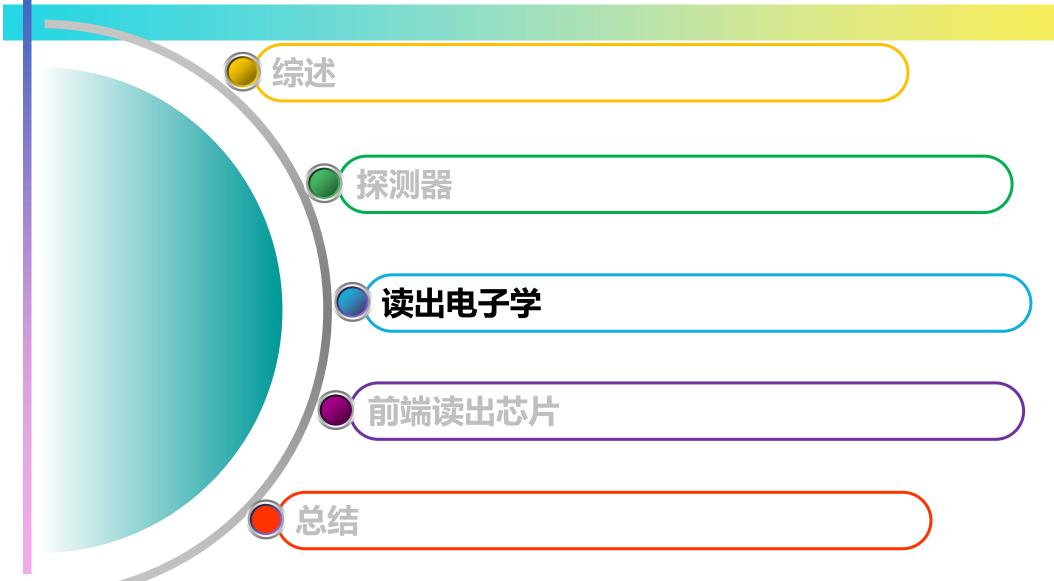
- ・ 准备7月束流测试框架
- · 优化tracker性能(磁场下)
- 更薄的漂移气隙: 3mm
- ・ 更高的漂移场: 3kV/cm
- · 由此得到更小的洛伦兹角: ~6°(模拟值);

径迹误差预期 <80μm (模拟值)

摘要







完成基于APV25的1024路原理样机系统研制



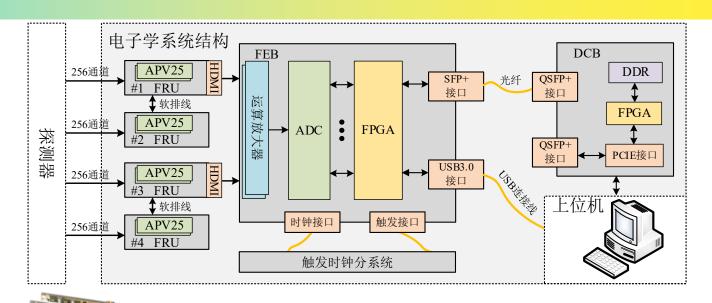


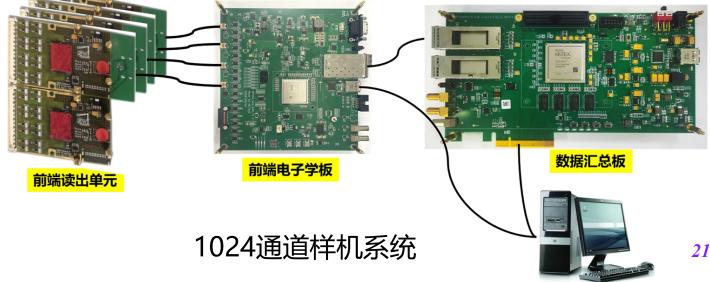
◆ 系统构成:

- ➤ 1块背板承载2块ASIC板
- ➤ 2块背板互联后通过HDMI与FEB板连接
- ▶ FEB板上承载ADC和FPGA芯片
- ➤ FEB板可通过SFP与数据汇总板连接
- ▶ 数据汇总板通过PCIE接口与服务器连接

◆ 主要工作:

- ▶ 固件方面完成了对APV输出数据的处理, 组包后采用光纤读出
- 完成上位机软件设计并完成基线噪声、能量分辨、线性等测试





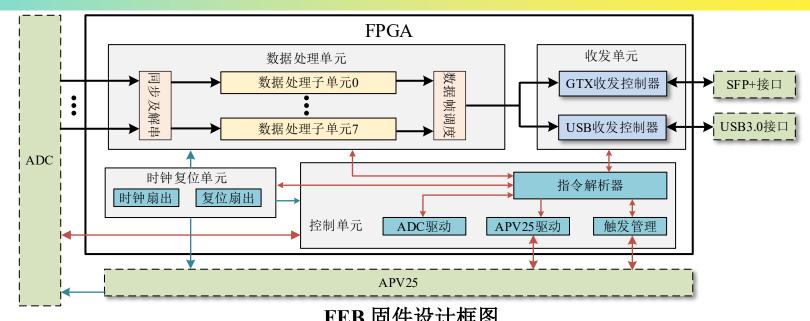
完成基于APV25的1024路原理样机系统研制



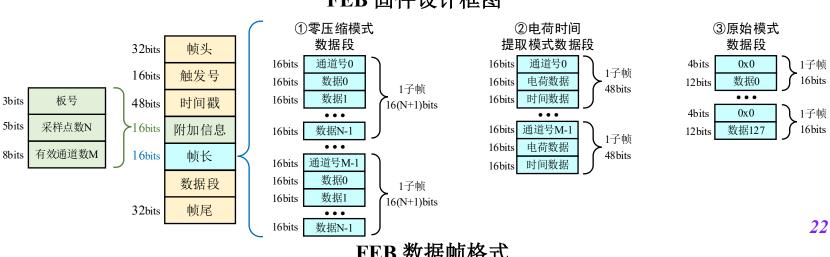


- FEB 固件设计
 - 控制单元
 - 数据处理单元
 - 数据收发单元
 - 时钟复位单元

- ◆ FEB 协议帧设计
 - 包含组帧状态机与异步组 帧FIFO。
 - 实现三种模式下的帧格式 输出,区别在于数据段。



FEB 固件设计框图



实验室测试





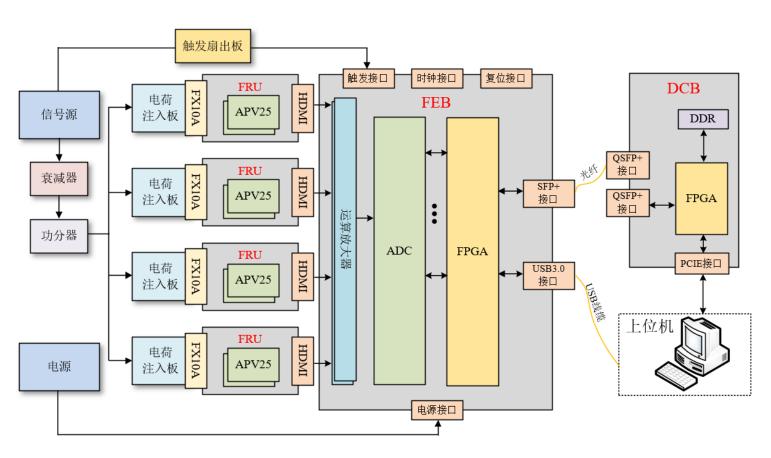
◆ 测试方案

由数字信号源提供周期性指数衰减脉冲信号,经衰减器幅度调整,功分器扇出,输入自制的电荷注入板并扇出到APV25的模拟输入通道。

◆ 所需仪器

▶ 电源

- ▶ 电荷注入板
- ▶ 信号源
- ▶ 触发扇出板
- ▶ 衰减器
- > FRU、FEB、DCB
- ▶ 功分器



测试系统框图

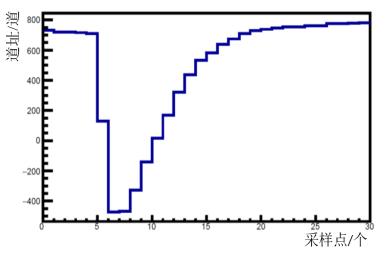
实验室测试



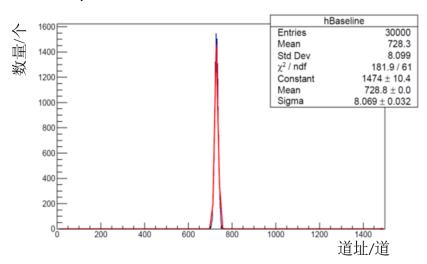


◆ 测试结果

- ▶ 信号波形重建测试: 前沿包含两个采样点(50 ns)与芯片参数相符。
- 系统噪声测试: ENC为0.16 fC,满足原型电子学系统好于1.3 fC的指标需求。
- ▶ 电荷分辨测试:20 fC输入下电荷分辨精度约为0.13fC,满足要求。

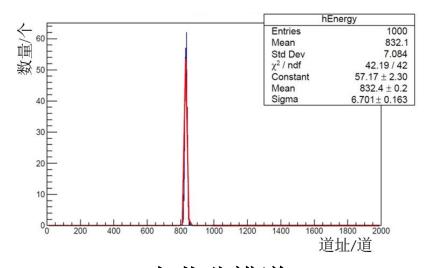


信号波形重建图 (20 fC)



实验室基线噪声谱

输入电荷	电荷分辨	电荷分辨
(fC)	(単峰模式)	(多峰模式)
4	2.5%	3.1%
8	1.3%	1.4%
12	0.8%	0.8%
16	0.67%	0.68%
20	0.48%	0.45%



电荷分辨谱

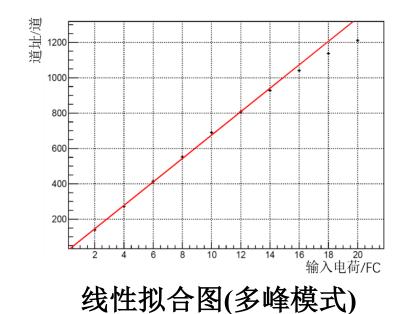
实验室测试





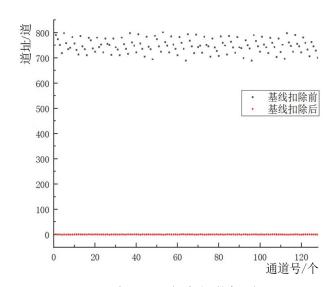
◆ 测试结果

- ▶ 积分非线性测试: 在0-20fC内单峰模式下积分非线性指标要优于多峰模式,好于2.6%。 在0-12fC,线性拟合度很高,测试结果好于0.26%。
- 通道一致性测试:通过基线扣除方法,可实现较好的通道一致性。



型 1000 800 400 200 200 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 输入电荷/FC

线性拟合图(单峰模式)



通道一致性散点图

实验室测试总结





◆测试结果满足指标要求

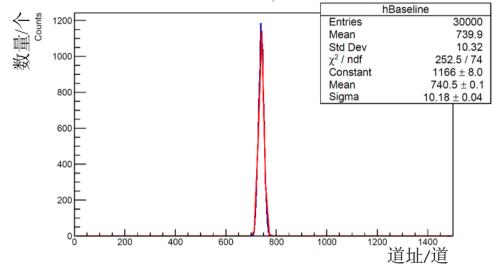
系统指标类型	具体要求参数	实测参数
总读出通道	1024通道	1024通道
计数率	大于10 kHz	最高150 kHz
等效噪声电荷	小于1.3 fC RMS	小于0.16fC RMS
电荷测量动态范围	20 fC	20 fC
积分非线性	小于4%	小于2.6%(单峰模式)

联合探测器测试

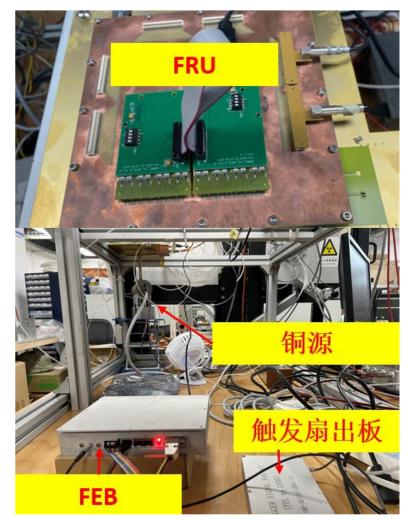




- ◆ 探测器现场组成
 - 深测器测试现场包括X射线源、 μRGroove探测器和原型电子学系统。如图所示, X射线源使用牛津仪器公司的 XTF5011型X光机,通过加速电子轰击铜靶产生特征X射线。
- ◆ 联合探测器系统噪声
 - ▶ 在联合探测器测试中,将电子学系统连接探测器后得到的基线谱如图所示,系统噪声略微变大,达到0.2 fC。



探测器基线噪声谱

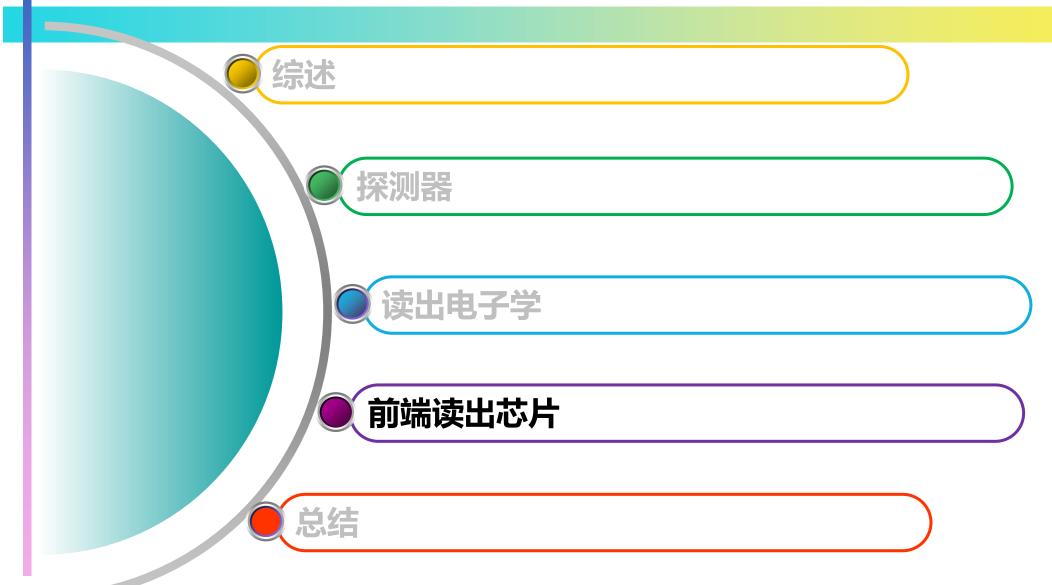


探测器测试现场图

摘要







前端读出芯片的挑战





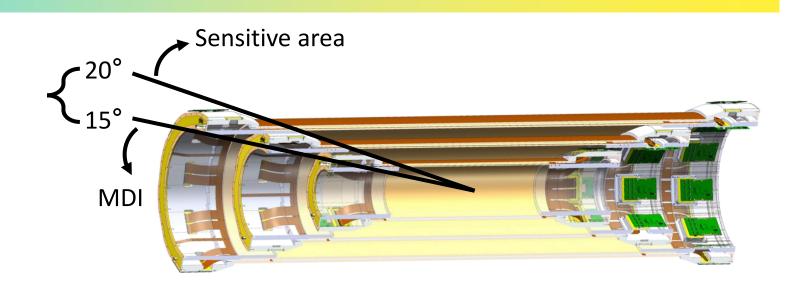
1. 读出电子学空间受限



・高集成度



- · 采用专用集成电路芯片 (ASIC)
 - > 多通道集成
 - > 片内信息提取与数字化



- 2. 高计数率能力 (单通道极限计数率高达4 MHz)
- 3. 数十pF输入电容下实现微弱信号 (~fC) 放大



前端读出芯片的挑战





为了满足气体型内径迹探测器的读出需求,有必要采用定制化的专用集成电路芯片,其需要满足:

- > 高集成度
- ➤ 低噪声
- > 高计数率能力

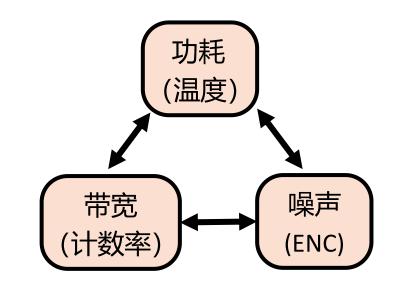


原理验证芯片32通道,最终版本64通道 片内提取信息并数字化



对模拟调理电路和信息提取电路构架进行针对性优化

参数	设计需求
单芯片通道数	64 通道
单通道极限计数率	4 MHz
电荷测量上限	40 fC
等效输入电荷噪声 (ENC)	≤ 0.5 fC RMS @ 35 pF C _{in}
电荷测量精度	≤ 1 fC RMS
时间测量精度	≤ 10 ns RMS



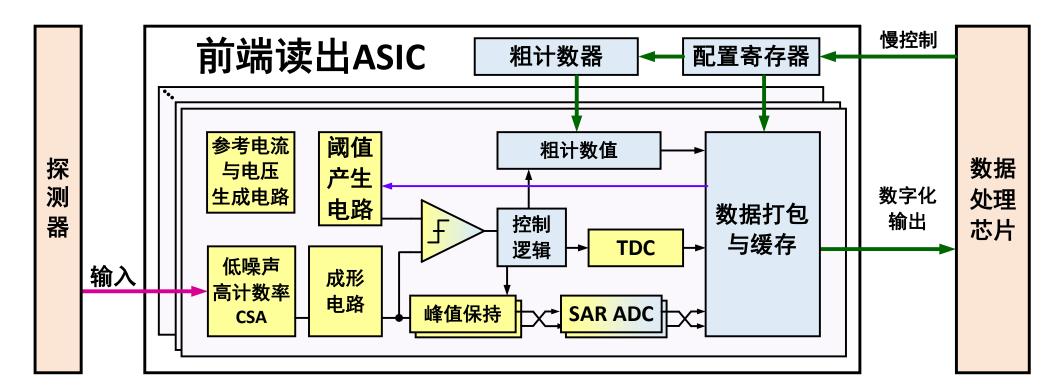
芯片基本构架





原理验证芯片集成32个通道,每通道包含:

- 电荷灵敏放大器 (CSA) +成形电路 ——→ 微弱信号低噪声放大
- 峰值保持 + 模数转换器 (ADC) 电荷测量
- 甄别器 + 时间数字转换器 (TDC) → 时间测量

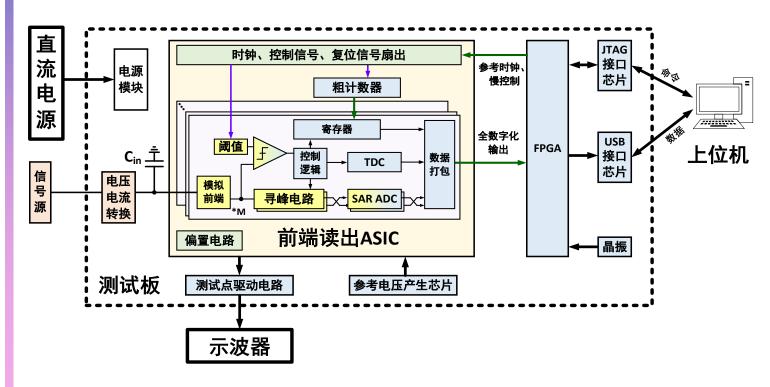


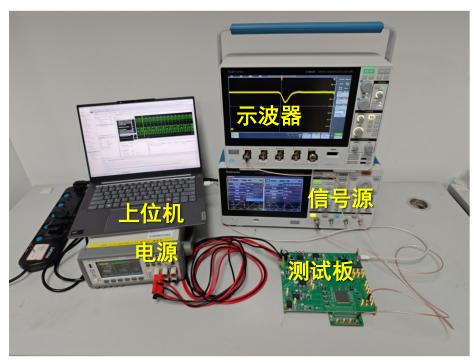
测试平台构建





- 在芯片完成流片、封装与测试板焊接后,对其性能进行测试
- 使用信号源结合电压电流转换电路模拟探测器输出电流信号





测试平台框图

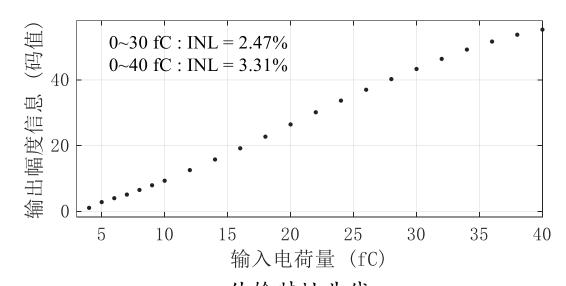
测试现场照片

传输特性曲线与噪声测试

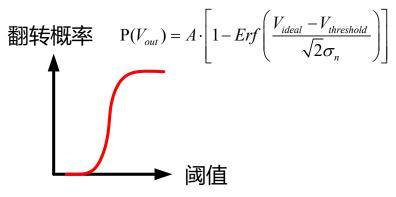


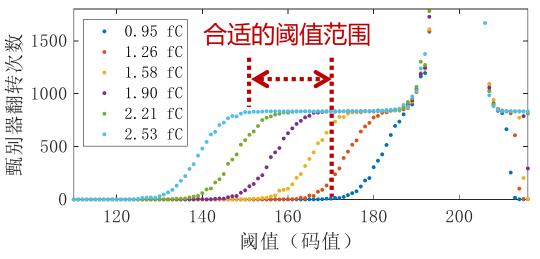


- 在全动态范围内积分非线性好于3.4%。
- 使用S-curve方法对芯片的基线噪声进行测试,当阈值码值设置在 150~170范围内时,能在较低的误触发率下对75 ns电荷收集时间 的2.5 fc信号实现较高的探测效率。



传输特性曲线 @ 35 pF输入电容 @ 75 ns 电荷收集时间





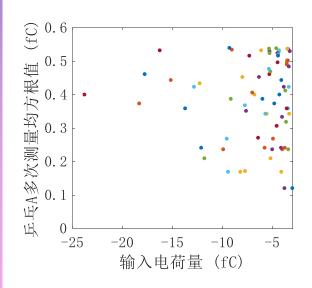
在固定时间内不同阈值下的甄别器翻转次数 @ 35 pF输入电容 @ 75 ns电荷收集时间

电荷与时间精度测试

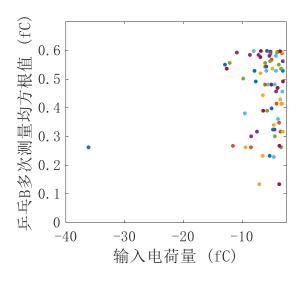




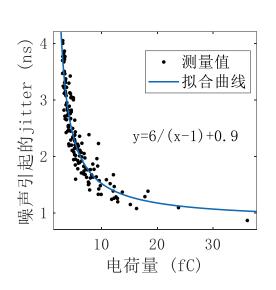
- 为了更合理评估芯片性能,使用GENT4模拟波形作为测试输入,在35 pF输入电容下对电荷测量精度和时间测量精度进行测试。
- 测试结果显示,电荷测量精度好于1 fC RMS,时间测量精度好于10 ns RMS,满足设计指标需求。通过幅度信息可对时幅游走效应进行修正,进一步提升时间测量精度。



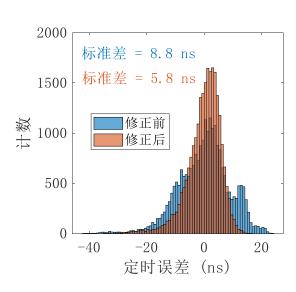
乒乓通道A电荷测量精度 随输入电荷量的关系



乒乓通道B电荷测量精度 随输入电荷量的关系



噪声引起的时间抖动 与电荷量间关系



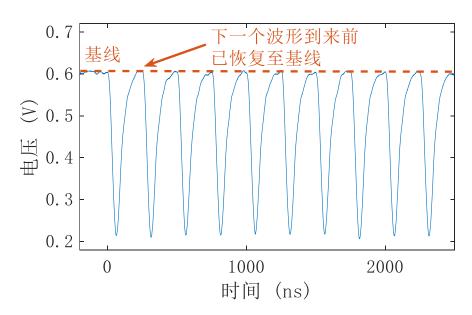
根据幅度值对定时信息进行修正后的结果

计数率能力测试

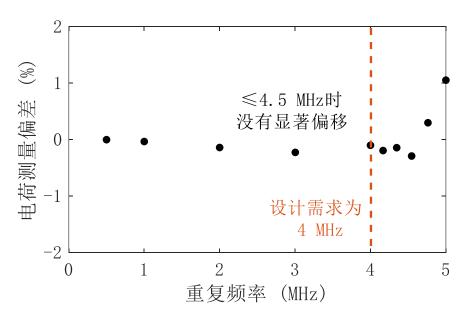




- 向芯片以4 MHz极限计数率连续注入满量程信号
 - > 模拟调理电路输出无堆积
 - > 电荷测量无显著漂移
- 表明芯片极限计数率满足设计需求



4 MHz计数率下模拟调理电路输出波形

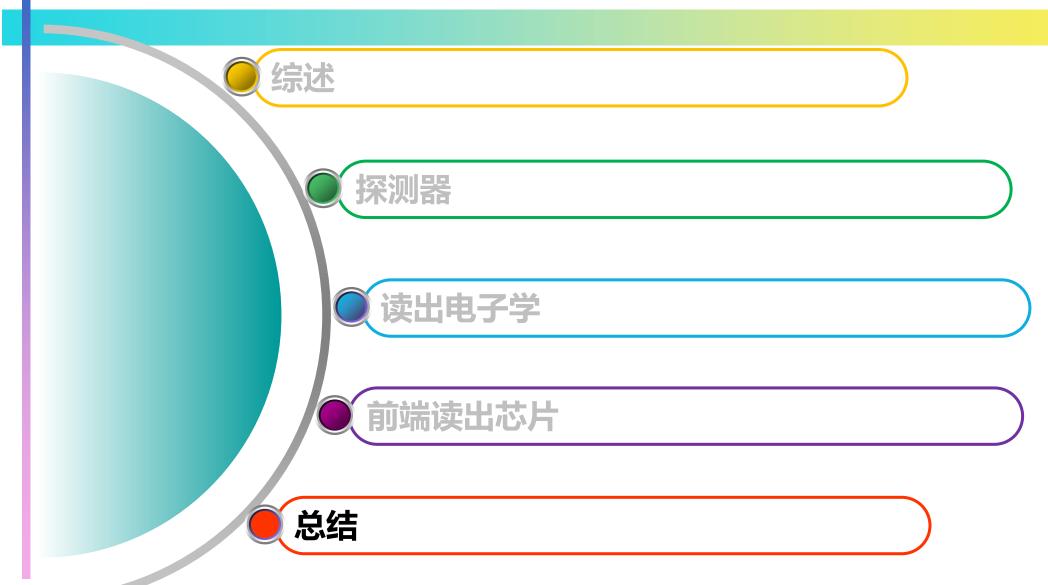


芯片输出计数率与输入计数率关系

摘要







总结





- > 完成了第一版本C-μRGroove原型的设计与测试
- > 完成了基于APV25芯片的读出电子学原型设计与测试
- > 完成了原理验证前端读出芯片的设计与测试
- > 正在展开进一步优化设计工作

向Rui及其团队在探测器研发和 生产方面给予的支持、以及Eraldo及 其团队在束流测试过程中的帮助表示 诚挚的感谢!!!







